

平成30年度 基盤研究（S） 審査結果の所見

研究課題名	電子供与の増幅による低温作動アンモニア合成触媒の開発
研究代表者	原 亨和 (東京工業大学・科学技術創成研究院・教授) ※平成30年7月末現在
研究期間	平成30年度～平成34年度
コメント	<p>本研究は、低温・低圧で動作するアンモニア合成触媒の開発を目的としている。応募者は電子供与能の高い担体を用いることにより、アンモニア合成活性が向上することを既に見いだしている。本研究では、これを基礎として、新たな触媒設計により電子供与能を更に増幅し、低温、低圧の条件下において高収率のアンモニア合成固体触媒を実現することとしている。</p> <p>定量的な達成目標が設定され、また、研究内容には応募者の独自性が認められており、大きな社会的インパクトが期待できる研究である。</p>